(F16p08)

Design study of a $\pi/2$ mode standing wave RF gun with a thermionic cathode

Fumihiko Oda^a, Minoru Yokoyama^a, Akihiro Nakayama^a and Eiji Tanabe^b

^a Kawasaki Heavy Industries Ltd.
118 Futatsuzuka, Noda, Chiba, 278 Japan
^b AET Associates, Inc.
1-3-4 Kamiasao, Asaoku, Kawasaki, Kanagawa, 215 Japan

A new type of RF gun with a thermionic cathode was designed. The fundamental design of the RF gun is the $\pi/2$ mode standing wave structure with two accelerating cavities and a couple-cavity located on the beam axis, so called on axis couple structure (OCS). This structure offers much stable operation for high beam current, owing to high group velocity and wide bandwidth. It is important to decrease damage onto the cathode by back bombardment especially for long macropulse operation, such as an FEL injector. Back bombardment as well as output beam profiles was simulated by using electromagnetic field analytic codes 'EMSYS'. The cavity was designed so as to minimize the back bombardment power without sacrificing beam emittance.

π/2モード定在波型熱陰極 RFGUN の設計

-136-

1. 熱陰極 RFGUN の概要

高周波電子銃(RFGUN)は静電型電子銃に比べては るかに大きな電界により電子を加速するためエミッタン スの増加を最小限に抑えることができ、かつ静電型電 子銃+バンチャーのシステムに比べて装置を大幅に 小型化できる。特に熱陰極を用いた RFGUN は、装置 全体として小型・安価であり、カソード寿命についても 信頼性の高い材質の製品が開発されている。その一 方で RF の逆位相によりカソード方向に逆加速された 電子(バックボンバードメント)により、放出電流が異常 に増加するため、マクロパルス幅が制限されるという欠 点がある。バックボンバードメントを低減し、長マクロパ ルス運転が可能となれば、熱陰極 RFGUN は小型・安 価でかつ信頼性の高い入射器としてさらに幅広い応用 が可能になる。

2. 本設計の目的

本設計では赤外領域のリニアック FEL への適用が可 能な S-band 熱陰極 RFGUN の設計を目的とした。要求 される電子ビームのスペックを表 1 に示す。

	A COLUMN AND A COLUMNA AND A COLUMN AND A					
ピーク電流値	>	30	А			
規格化エミッタンス	<	20	π mm-mrad			
ビームエネルギー	>	1.5	MeV			
エネルギー幅(FWHM)	<	60	keV			
マクロパルス長	>	3	μs			
表1 電子ビームの要求スペック						

要求仕様を満たすためには、良好なエミッタンスを保ちながら、大ビームカレントを加速するためビームロー ディングに対して安定であること及び長マクロパルス運転を可能とするためバックボンバードメントを低減するこ とが必要である。

3. シミュレーションコード

本設計には AET 社の円筒対称 2 次元電磁場解析・ 粒子軌道計算コード"EMSYS"を用いた。本コードは 空洞内の電磁場中における粒子の運動の時間発展を 解くものであり、粒子間及び粒子と空洞の相互作用を 考慮している。このコードを用い、入力 RF、カソードの パラメータ及び空洞形状の最適化を行った。

4. 空洞形状

本設計では、2 つの加速空洞をビーム軸上の結合空 洞により結合した構造(on-axis couple structure)[1,2]を 採用することとした。図1に最適化された空洞の概形を 示す。



図1本設計による最適化空洞形状

第2空洞は結合空洞(couple cavity)であり、各加速空洞とはビーム軸上で電気的に結合している[3]。この構造は、以下のような特徴を持っている。

- (a)励振モードがRFの群速度が最大であるπ/2定在波 モードであるので、ビームローディングに対して非常 に安定で、チューニングが容易である。
- (b)結合定数比を変えることで、第1空洞と第3空洞の 電界強度比を自由に設計できる。
- (c)空洞全体として軸対称の構造であり、製作の容易性 に優れている上に、ビームに影響を与える非対称な モードの発生を極力抑えることができる。

図2に最適化形状の軸上電界分布を示す。



図2軸上電界強度分布

5. ビームダイナミクス

表2に入力RF及びカソードのスペックを示す。

放出電流密度	16	A/cm^{2}				
カソード径	φ6	mm				
入力 RF パワー	4.5	MW				
入力カプラ結合定数	6					
表 2 入力 RF・カソードのスペック						

カソードは酸化陰極を用いることを仮定し、計算に用いた電流密度は16A/cm²である。

第1空洞・第2空洞間の結合定数をk₁₂、第2空洞・ 第3空洞間の結合定数をk₂₃とすると、次のような関係 が成り立つ[4]。

 $k_{12} / k_{23} = \{ (R/Q)_1 V_3 \} / \{ (R/Q)_3 V_1 \}$

ここで(R/Q)_nは第n空洞のシャントインピーダンスを表 す。従って、空洞間結合定数比(k₁₂/k₂₂)を変えることで、 第1空洞と第3空洞の電界強度比を変えることができ る。この特長を生かし、ビームエミッタンスを犠牲にする ことなく、バックボンバードメントが最小になるように形状 及び電界強度比(空洞間結合定数比)を最適化した。

最適化空洞のスペック及びビーム軌道解析の結果を 表3に示す。また出力ビームのエミッタンスプロット及び エネルギー分布を図3に示す。

			-
空洞間結合定数	k ₁₂	3.6	%
	k ₂₃	1.4	%
カソード上電界		30	MV/m
最大軸上電界		65	MV/m
最大表面電界		140	MV/m
ピーク電流値		30	А
規格化エミッタンス		11	π mm-mrad
ビームエネルギー		1.9	MeV
エネルギー幅(FWHM)		30	keV

表3 最適化空洞と出力ビームのスペック







6. バックボンバードメント

本設計による RFGUN と、BNL タイプ 1.6 空洞 RFGUN[5](カソードは同じものを用いたと仮定した。) についてバックボンバードメントの比較を行った結果、 約 40%バックボンバードメントパワーを低減することが できた。マクロパルス長 5 µ s、繰り返し数 10ppsとする と、平均バックボンバードメントパワーは約 1.1Wとなる。 本設計の最適化空洞と BNL タイプ空洞のバックボン バード電子のエネルギー分布を図 6 に示す。



図4より、第1空洞及び第3空洞(第2加速空洞)から 逆加速された電子を表すピークが見られ、本設計空洞 では、第1空洞からの電子のピークのエネルギーが小 さく(約0.6→0.2MeV)なっており、第1空洞の電界強度 を小さくしたことで、第1空洞からの電子の寄与が大き く減少していることがわかった。

バックボンバードメントパワー密度の径方向分布を図 7 に示す。



図7 バックボンバードメントパワー密度の径方向分布

図 7 よりカソード中心部ほどバックボンバードメントパワー密度が大きいことがわかる。これは第1 空洞及び第3空洞(第2加速空洞)から逆加速された電子がカソード中心付近に収束しながら衝突することが原因であることがわかった。

カソード中心に穴を開け、中心部へのバックボンバード電子をビームダンパで受ける構造のカソードを用いれば、バックボンバードメントの影響を大幅に低減することができると考えられる。

7. まとめ

ビームローディングに対して非常に安定な、新しい構造(on axis couple type)の RFGUN 空洞についてシミュレーションコードを用いた最適化設計を行った。結合空洞との結合定数比(k₁₂/k₂₃)により、第1空洞と第3空洞の加速電界比を大きく変えることができ、バックボンバードメントについてはこの特徴を活かして、大幅に低減できることを示した。また、中空構造のカソードを用いることでさらにバックボンバードメントの影響を低減できることを示した。

今後、本設計を基にモックアップ空洞による低電力 試験、空洞の製作・試験を順次行っていく予定である。

Reference

- [1]T. Nishikawa et al, Rev. Sci. Inst. 37, 652, (1966)
- [2]E. A. Knapp et al, Rev. Sci. Inst. 39, 979, (1968)
- [3]Y. Yamazaki, Proc. 1992 Linear Accel. Conf., 580, (1990)
- [4]M. Foley et al, Proc. 1993 Part. Accel. Conf., 852, (1993)
- [5]D. T. Palmer et al, Proc. 1995 Part. Accel. Conf., 982, (1995)